



聴講  
無料

## 出展者セミナーのご案内

### 現場で役立つ!

## 製造装置のダウンタイム低減とライフタイム延命

～トラブルシューティング、プロセスの最適化・診断・管理の提案～

近年のIoT向け電子機器、半導体産業市場の成長により、装置稼働率が向上している一方で、現場で稼働している製造装置の歩留りや仕様変更の対応に課題、また装置周辺機器の取り扱いやトラブルへの対応に不安をお持ちではないでしょうか。

本セミナーではそれらの課題や不安をお持ちの方に現場で役立つトラブルシューティング、プロセスの最適化・診断・管理についてご紹介いたします。

日時

12月15日(金) 13:40 - 14:30

場所

東京ビッグサイト(東4ホール)

TechSPOT EXHIBITOR SEMINARS



### セミナーにてご紹介する製品

成膜プロセス用マルチガス  
クリーニング終点検知

濃度



ガスモニタ  
IR-400

真空チャンバの  
状態把握・管理

分圧



コンパクトプロセス  
ガスモニタ  
MICROPOL System

プラズマ状態の  
分析・プロセス管理

プラズマ



プラズマ発光モニタ  
EV-140C

WEB 事前登録はこちら [www.horiba.com/jp/semicon2017/seminar/](http://www.horiba.com/jp/semicon2017/seminar/)



株式会社 堀場エステック

本社 / 〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11-5 TEL (075)693-2311

[www.horiba-stec.jp](http://www.horiba-stec.jp)